

イオン注入装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号ロ(二)、(三)、(四)、(五)

貨物名： _____
 メーカー名： _____
 型及び銘柄： _____

パラメータシート
 様式：6-17-2/ロ
 CISTEC 2013.10.15

(平成25年10月15日施行政省令等対応)

質問事項	回 答	備 考
ロ イオン注入装置又はその部分品若しくは附属品か？ (解釈)「部分品、附属品」：他の用途に用いることができるものを除く。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 (_____) 以下本体装置で判定
(一) 削除		
(二) 水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したものか？	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい ↓イオンの種類 (_____) ビームエネルギー (_____ keV) ビーム電流 (_____ mA)
(三) 直接描画を行うことができるものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓
(四) 加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合において、ビームエネルギーが65キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が45ミリアンペア以上で注入が可能か？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓ビームエネルギー (_____ keV) ビーム電流 (_____ mA)
(五) 600度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合において、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化されたものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓ビームエネルギー (_____ keV) ビーム電流 (_____ mA)
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等 省令第6条第十七号ロ(_____) [(_____)内に該当番号を記入する]	

(注1) 回答の下の()内には、名称または数値(設計値、カタログ又は仕様書等のもの)を記入する。

(注2) 回答欄右欄の「 はい」のいずれか一つでもチェックされた場合は、該当と判定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者： (作成年月日 年 月 日) _____
 会社名 _____
 所属・役職 _____
 (フリガナ) _____
 氏 名 _____ 印
 電 話 _____ (_____)